



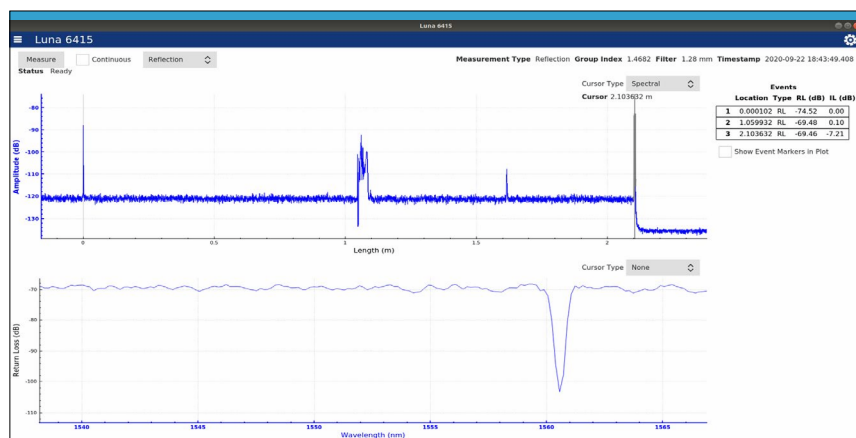
Luna 6415

光器件分析仪



Luna 6415光器件分析仪主要用于分析无源光器件和模块，其测试速度快且易于操作。可以测试插损（IL）和回损（RL）分布，以及器件长度，具有反射和透射两种测量模式。

Luna 6415光器件分析仪采用光频域反射技术（OFDR），通过探测背向瑞利散射光或者透射光获取其与距离的函数关系。Luna 6415作为光子集成电路和硅光芯片的理想分析仪，得益于其超高的灵敏度和空间分辨率（20 μ m）。Luna 6415单台仪器通过选择反射或者透射模式就能完成IL、RL、长度等所有测试，大大降低了测试成本，同时简化了测试流程。相比其它测试系统，将大大增加测试产量。



反射测量模式下，Luna 6415获取回损分布（vs 长度）。
下面的曲线显示了被选中的反射事件（滤波器）的光谱特性。

关键特性

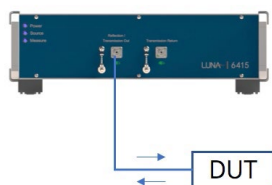
- 回损（RL）和插损（IL）分析
- 反射和透射模式分析器件
- 光路长度方向上的回损分布
- RL和IL的光谱分析
- 探测和精准定位反射事件和测量光路长度（长达100米）
- 优化生产测试的速度、空间分辨率和精度：20 μ m采样分辨率

应用

- RL空间分布测试
- IL自动测试和分析
- 延迟测量分辨率可达亚皮秒
- PLCs、光波导器件、AWGs和ROADMs等测试
- 耦合器、光开关和分束器等测试

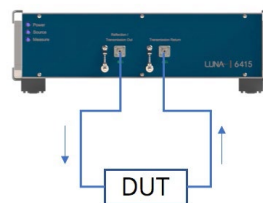
高速、高空间分辨率 OFDR 测量技术用于生产测试

反射测量模式



- 反射率、RL vs 长度
- 事件损耗测量 (RL, IL)
- RL光谱幅值分析
- 事件长度测量

透射测量模式



- 待测器件整体插损测试 (IL)
- 光谱响应
- 整体光路长度测试

性能

参数	指标	单位
测试		
空间分辨率 (两点) ¹	20	μm
测量长度	反射模式	20, 50, 100 ²
	透射模式	40, 100, 200 ²
波长范围	40	nm
波长精度 ³	1.5	pm
延迟精度 ³	± 0.0034	%
中心波长	1546.69	nm
测量时间 (20m长度模式)	0.08	s
最大光功率	5	mW
回损特性 (反射模式)		
动态范围 ⁴	70	dB
测试范围 ⁵	0至-130	dB
灵敏度 ⁵	-135	dB
分辨率 ⁶	± 0.1	dB
精度 ⁶	± 0.5	dB
插损特性 (反射/透射模式)		
IL动态范围, 透射模式	70	dB
IL动态范围, 反射模式 ⁷	15	dB
分辨率 ⁸	± 0.1	dB
精度 ⁸	± 0.2	dB
物理特性		
测试端口类型	FC/APC	-
最大功率	50	W
重量 (不含控制器)	13 (6)	lb (kg)

订购信息

产品#	描述	包含
Luna 6415	光器件分析仪	Luna 6415 C波段主机箱 (20 m 和 50 m 长度模式测量)、仪器控制器 (工作站笔记本电脑)、应用软件和配件包。
OPT06450	扩展模式选项	Luna 6415的扩展测量长度可达 100 m (反射模式)

NOTES

1. Distance between two sample points along the length axis in SMF-28.
2. With extended range option OPT06450.
3. Accuracy guaranteed via internal NIST-traceable HCN gas cell.
4. Range between strongest reflection greater than -60 dB and noise floor.
5. Noise floor return loss at half of maximum length.
6. Measured with 1 cm integration width.
7. Two way loss before backscatter reaches noise floor and IL measurements are no longer possible.
8. Measured with 10 cm integration width.